

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年3月3日 (03.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/020243 A1

(51) 国際特許分類: G12B 21/08, G01N 13/16

(KOBAYASHI, Dai) [JP/JP]; 〒1570061 東京都世田谷区北烏山八丁目31番15-303号 Tokyo (JP). 川勝英樹 (KAWAKATSU, Hideki) [JP/JP]; 〒1580086 東京都世田谷区尾山台一丁目9番18号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009911

(22) 国際出願日: 2004年7月12日 (12.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(74) 代理人: 清水守 (SHIMIZU, Mamoru); 〒1010053 東京都千代田区神田美土代町7番地10大園ビル Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-275200 2003年7月16日 (16.07.2003) JP

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AB, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県川口市本町四丁目1番8号 Saitama (JP).

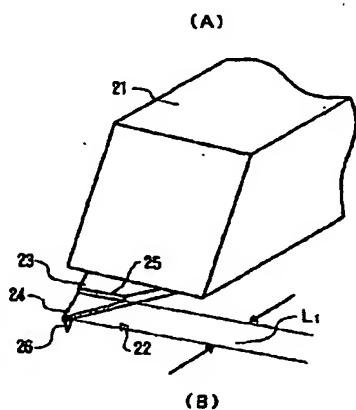
(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 大

(続葉有)

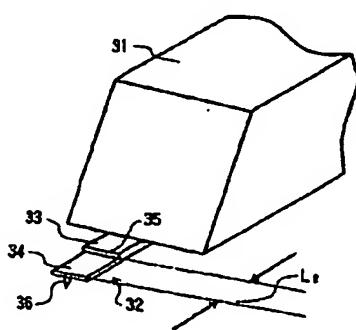
(54) Title: PROBE FOR SCANNING PROBE MICROSCOPE AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 走査型プローブ顕微鏡のプローブおよびその製造方法



(57) **Abstract:** A probe for a scanning probe microscope and a method of producing the probe, where the probe is capable of performing accurate measurement without the base of a cantilever coming in contact with an object to be measured and without the object being hidden by the base of the probe. A probe for a scanning probe microscope has a base (21, 31), a cantilever (23, 33) for support, horizontally extending from the base (21, 31), and a cantilever (24, 34) for measurement, provided at the head of the supporting cantilever (23, 33) and having a length of 20 micrometers or less and a thickness of 1 micrometer or less.

(57) **要約:** カンチレバーの基部が測定対象物に接触することなく、かつ測定対象物がカンチレバーの基部によって隠されることなく、的確な測定を行うことができる走査型プローブ顕微鏡のプローブおよびその製造方法を提供する。走査型プローブ顕微鏡のプローブの基部 (21, 31) と、この基部 (21, 31) から水平方向に伸びた支持用カンチレバー (23, 33) と、この支持用カンチレバー (23, 33) の先端に長さ20マイクロメートル以下で、厚さ1マイクロメートル以下の測定用カンチレバー (24, 34) が設置されるようにする。



WO 2005/020243 A1